

## B. Patterning 분과

2017년 2월 15일 (수), 08:30-10:00  
Room F (제이드, 2층)

### [WF1-B] Plasma and Patterning Processes

좌장: 김현우(한양대학교), 유원종(성균관대학교)

<b>WF1-B-1</b> 08:30-08:45	<b>Work-Function Control of Ultrathin Transition Metal Dichalcogenides by Using Argon Plasma Treatment and Kelvin Probe Force Microscopy</b> Inyong Moon and Won Jong Yoo <i>Sungkyunkwan Advanced Institute of Nano-Technology, Sungkyunkwan University</i>
<b>WF1-B-2</b> 08:45-09:00	<b>Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:Eu<sup>3+</sup> 박막형광체 발광 효율을 향상시키는 유·무기 하이브리드 나노재료를 포함하는 2차원 나노구조체 연구</b> 김효준 <sup>1</sup> , 고기영 <sup>2</sup> , 박인성 <sup>3</sup> , 안진호 <sup>1,3</sup> <i><sup>1</sup>한양대학교 신소재공학과, <sup>2</sup>한국특허정보원, <sup>3</sup>한양대학교 나노반도체공학과</i>
<b>WF1-B-3</b> 09:00-09:15	<b>Analytical Study of Bowing Effect in Fluorocarbon Plasma Etching for Nanoscale Trenches Using Polymer Re-Emission and Re-Deposition Model</b> Sun-Woo Kim <sup>1</sup> , June Park <sup>1</sup> , Hwan-Jun Zang <sup>1</sup> , Gwang-Sik Kim <sup>2</sup> , Min Woo Ha <sup>3</sup> , Sang Soo Park <sup>3</sup> , Choon Hwan Kim <sup>3</sup> , and Hyun-Yong Yu <sup>2</sup> <i><sup>1</sup>Department of Nano-Semiconductor, Korea University, <sup>2</sup>School of Electrical Engineering, Korea University</i>
<b>WF1-B-4</b> 09:15-09:30	<b>Transistor CD Uniformity 열화 원인 분석 및 개선 방법 연구</b> Hyunseong Kim, Minae Yoo, Kyujin Choi, Jaeseung Choi, Chanha Park, and Hyunjo Yang <i>Research &amp; Development Division, SK Hynix Inc.</i>
<b>WF1-B-5</b> 09:30-09:45	<b>물중탕 습식 식각 공정을 이용한 대면적 EUVL용 SiNx 펠리클 제작</b> 정성훈 <sup>1</sup> , 김정환 <sup>2</sup> , 김지은 <sup>1</sup> , 안진호 <sup>2</sup> <i><sup>1</sup>한양대학교 나노융합과학과, <sup>2</sup>한양대학교 신소재공학과</i>
<b>WF1-B-6</b> 09:45-10:00	<b>OES 데이터 분석을 통한 플라즈마 진단 방법론 개발</b> Gwanjoong Kim, Yongjin Kim, Youngcheol Kim, Mihye Lee, Donggoo Choi <i>Research &amp; Development Division, SK Hynix Inc.</i>